

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表2005-532974(P2005-532974A)

【公表日】平成17年11月4日(2005.11.4)

【年通号数】公開・登録公報2005-043

【出願番号】特願2004-520511(P2004-520511)

【国際特許分類】

C 03 C 17/02 (2006.01)

C 03 B 8/02 (2006.01)

C 03 C 17/25 (2006.01)

【F I】

C 03 C 17/02 B

C 03 B 8/02 A

C 03 B 8/02 B

C 03 C 17/25 A

【手続補正書】

【提出日】平成17年8月1日(2005.8.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項3】

アルコキシドが好ましくはテトラメチルオルトシリケート、テトラエチルオルトシリケート、テトラプロピルオルトシリケート、テトラブチルオルトシリケート、エチルトリエトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、又は前記のものの混合物の中から選択されている、請求項1記載の基板上へのガラス状膜の製造及び堆積方法。